# BEST AVAILABLE COPY PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-205649

(43)Date of publication of application: 10.09.1987

(51)Int.CI.

H01L 23/00

H01L 23/28

H01L 27/14

(21)Application number: 61-047245

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

06.03.1986

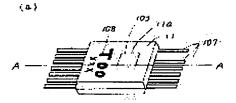
(72)Inventor: KOMATSU NOBORU

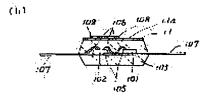
## (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To shorten processes, to improve the yield and to reduce the cost of a material, by providing a light shielding layer for an operating IC wit a marking liquid.

CONSTITUTION: A marking-liquid solidified layer 11 is deposited on the upper surface region of an operating IC 102 on a light transmitting sealing resin body 103. The liquid is not attached to the upper part of a light receiving element 101 and avoided. The liquid is applied only on the upper part of the operating IC. Or a window 11a is provided by using a mask. The formation of a mark forming layer 108 is performed on the marking-liquid solidified layer 11 by a method, which is completely the same as a conventional method. When, e.g., an ultraviolet-ray solidifying material is used as the marking liquid for forming the marking-liquid solidified layer, the solidification can be achieved quickly, and efficiency can be further improved.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# BEST AVAILABLE COPY

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 205649

@Int Cl 4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和62年(1987)9月10日

H 01 L 23/00

A - 6835-5F D - 6835-5F 7525-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 半導体装置

> 创特 願 昭61-47245

願 昭61(1986)3月6日 23出

⑫発 明 者 松

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

川崎市幸区堀川町72番地

願 株式会社東芝 ①出 人 邳代 理 弁理士 井上

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

半路体装置

外部光をとり入れる受光素子と、この受光素子 に接続し受光器子が発する世気信号によって動作 を行なう動作ICと、前記受光濲子と動作ICを・ 一体に封止する透光性封止樹脂体と、少くとも動 作ICに対向する前記透光性対止樹脂体の上部表 面域に被滑され外部光を遮断するマーク被固別と、 このマーク液過別上に被着されたマーク型別を具 備した半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

この発明は、外部光をとり入れる受光素子とこ の受光素子に接続し受光異子が発する電気信号に よって動作を行なう動作ICを聞えた半線体装置 に関し、特にカメラ用測光ICに使用されるもの である.

(発明の技術的背景)

湖光に用いられる半導体装置における従来の--例の構造を第2回に示す。第2回aは半導体装置 の斜辺図、第2回りは第2回aのAA線に沿う断 面図を示す。図中、101は受光楽子、102は上記受 光泉子が受光して発する電気信号によって動作 を行なう動作ICで、叙上の受光器子 101と動作 I C102は透光性対止樹脂体103、例えばエポキシ 樹脂で一体にモールド封止され、さらに動作IC 102 に不所望に外部光が入射することによって発 生する武動作を防止するために、上記透光性対止 樹脂体103の外側を進光性樹脂別104でモールドを 施すとともに、この遮光性樹脂層104 が受光報子 の受光面に対向する部分に光導入窓104aを設けて いる。なお、上記受光表子101, 動作 I C 102はい ずれも取付ヘッド105,105にマウントされ、各電 僅はポンディングワイヤ106, 106…で外部導出り ード107, 107…に接続されている。また、この半 原体装置の製品型名等を示すマーク型層108 は上 記避光性樹脂層104 上にマーキング手段によって 形成されたものである。

# BEST AVAILABLE COPY

#### 待開昭62-205649(2)

#### (背景技術の問題点)

上記従来の構造によると、動作ICに外部光が入別すると認動作するので、透光性料止樹脂体103の周囲をさらに進光性樹脂的104でモールドが施される。すなわち、二重モールド構造が必須で、しかも、受光瀬子上に光導入窓104aが必要であるため、製造に長時間を要するとともに、材料(モールド材)も高価につく。特に、上記光導入窓104aを設けることはここに進光性樹脂別が流れこみやすく、工程の歩部が低下するなどの問題がある。

#### (発明の目的)

この発明は上記従来の半導体装置の欠点に鑑み、 改良された構造の半導体装置を提供する。

#### (発明の概要)

この発明の半海体装置は、外部光をとり入れる受光素子、この受光素子に接続し受光素子が発する電気信号によって動作する動作 I C、上記受光潔子と動作 I Cを一体に封止する透光性封止規能体、少くとも動作 I Cに対向する上記透光性封止

求めることができる。そして、上記マーク被の塗 着にあたっては、特に受光素子101 の上方には付 着しないように避けて効作 I C 上方のみとするか、 またはマスクによって窓 Liaを設けるようにする。 次に、マーク型対 108 <sup>1</sup>の形成は上記マーク被固対 11上に従来の場合と全く同様に施される。

なお、上記マーク被問題形成のためのマーク被に、例えば第外線間化性のものを用いればこれの 聞化が迅速に達成できてさらに能率の向上をはか ることができる。

#### (発明の効果)

この発明によれば、従来の二重モールド構造としないので、モールド用の避光性樹脂層が不要でかつ、製造に要する時間も短縮でき、光導入窓形成のための不良発生もない等の顕著な利点がある。また、この発明における避光のためのマーク被の使用量も僅少でよく、廉価である利点もある。

# 4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明の半導体装置にかかり、第1 図のは斜視図、第1回しは第1回ののAA線に沿 樹脂体の上部表面域に被着され外部光を超所するマーク被固層、およびこのマーク被固層上に被着されたマーク型層を具備してなり、動作ICに対する遮光層がマーク液で施されるので製造工場の短端、歩電の向上、材料の低速化がはかれる。

#### 〔発明の実施例〕

以下、この発明の一次施例につき第1回を参照して説明する。なお、説明において従来と変わらない部分については図面に従来の各部と同じ符号を付けて示し説明を省略する。

第1回aは一次施例の半導体装置の斜視図、第 1回bは第1回aのAA線に沿う所面図を示す。

図において、11はマーク被囚別で、透光性封止 樹脂体103上にて、少くとも動作 I C 102の上前域 に被着されたものである。このマーク被固別11は 外部光を遮断するもので、外部光が例えば可視域 の光に対してはこれを遮断する思色の着色別が添加 に対してはこれを遮断する思色の着色別が添加 遮断する添加剤が加えられたマーク被または上記 思色の着色剤が添加されたマーク被として一般に

う断面図、第2図は従来の半導体製置にかかり、 第2図のは斜視図、第2図とは第2図 aの A A 線 に沿う所面図である。

| 11 マーク被周層 | 101 受光凝子

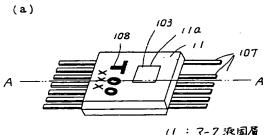
102 動作 I C 103 透光性封止樹脂体

108 マーク型層

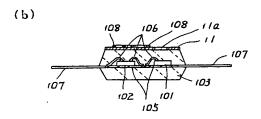
代理人 弁理士 非 上 一 男

# **BEST AVAILABLE COPY**

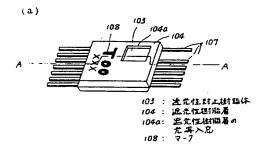
### 特開昭62-205649 (3)

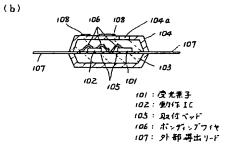


11 : 7-9 液固層 11a: 7-9 液固層の窓



第 1 図





π 2 🗵